

ISPlasma2026

IC-PLANTS2026

第18回先進プラズマ科学と窒化物及びナノ材料への応用に関する国際シンポジウム

18th International Symposium on Advance Plasma Science and its Applications for Nitride and Nanomaterials

第19回プラズマナノ科学技術国際会議

19th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science

日時: 2026年3月2日(月)～6日(金)

Dates: March. 2 (Mon.) - 6 (Fri.), 2026

場所: 名城大学

Venue: Meijo University

企業展示・広告募集要項

・企業展示 ・プログラム冊子広告





ISPlasma2026/ IC-PLANTS2026 企業展示・プログラム冊子広告募集のご案内

ISPlasma2026/ IC-PLANSTS2026 実行委員長
内田 儀一郎(名城大学)

拝啓 時下益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

このたび、第18回先進プラズマ科学と窒化物及びナノ材料への応用に関する国際シンポジウム/第19回プラズマナノ科学技術国際会議(18th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 19th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science 略称: ISPlasma2026 / IC-PLANTS2026)を、令和8年(2026年)3月2日(月)から3月6日(金)までの間、名城大学にて開催する運びとなりました。

本国際シンポジウムは、プラズマ分野で長い歴史と研究実績を有する東海地域に世界中から優れた研究者が集い、先進プラズマ科学、窒化物半導体とナノ材料への応用、産業界への技術移転の仕組みづくりについて広く議論する、世界でも類を見ない国際会議です。

本国際会議を開催し、最新の研究成果を発表及び討議することにより、各分野の研究への貢献に加えて、異分野融合による新たな価値創造や産業界の更なる発展に資する研究の展開することを目的としております。特に、本会議をきっかけに地球温暖化や資源エネルギー問題などの世界規模の社会課題の解決策にも繋がる研究成果が産み出されることを期待しています。

是非、この機会に展示会へのご出展等についてご検討賜りたく、お願い申し上げます。

Related Field

【Plasma Science & Technologies】

Plasma Source
Modeling & Simulation
Plasma DX & AI
Advanced Plasma Diagnostics
Plasma with Liquid
Thermal Plasma
Thin Film Deposition Process
Etching Process
Atomic Layer Process
Plasma for Nano & Green Technologies
Flexible Electronics
Aerospace / Space Applications

【Wide Bandgap Semiconductors】

Crystal Growth
Characterization
Optical & Optoelectronic Devices
Device Processing
Electron & Power Devices

【Nanomaterials】

Nanodots & Nanoparticles
Nanotubes, Nanowires & Nanorods
2D Nanomaterials
Porous Materials & Membranes
Composite & Functionally Graded Materials
Surface Modification & Functionalization
Applications for Energy & Environment
Nanomedicine & Sensing
Nano Integration & Devices

【Bio Applications】

Plasma Biology & Medicine
Plasma Agriculture
Biomaterials
Biomarkers
Bioimaging
Bio-Devices, μ TAS, Lab on a Chip
Biosensors
Device Fabrication Technologies

Organizing Committee

組織委員長	平松 美根男(名城大学)
組織副委員長	竹内 哲也(名城大学)
	伊藤 昌文(名城大学)
	石川 健治(名古屋大学)



企業展示

2026年
1月30日金
申込締切

発表会場の近くに展示会場を設けます。発表は完全対面(現地)での開催となります。

会期 2026年3月3日(火)～5日(木)

会場 名城大学 N棟1階

※企業展示室では常時コーヒーマシンを設置します。

展示会スケジュール 3月3日(火) 10:00～18:00
3月4日(水) 10:00～18:00
3月5日(木) 10:00～16:00

搬入 3月2日(月) 15:00～18:00

搬出 3月5日(木) 16:00～18:00

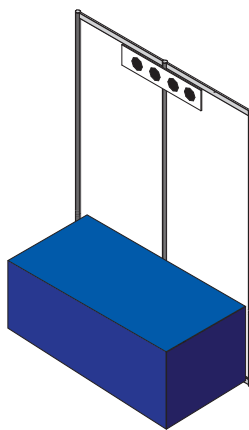
出展費用

1小間:150,000円(税別)

※出展特典

- ・1社・団体につき「プログラム」1冊
- ・会議参加証1枚
- ・参加者に配布・公開するプログラム冊子に開催企業名を掲載

▶値上げについてのお知らせ：材料費、人件費の大幅値上げにより出展料を値上げしました。ただし、ISplasma2026/IC-PLANTS2026に限り、昨年の出展者は据え置きとなります。昨年と同様の料金にてご請求をいたします。



出展料金に含まれる備品等

展示小間	1小間 (W1980×H2400mm)
社名板	1枚
展示台	1台 (W1800×D600×H730mm)
イス	1脚
電気	PC程度まで可
コンセント	1個(2口)

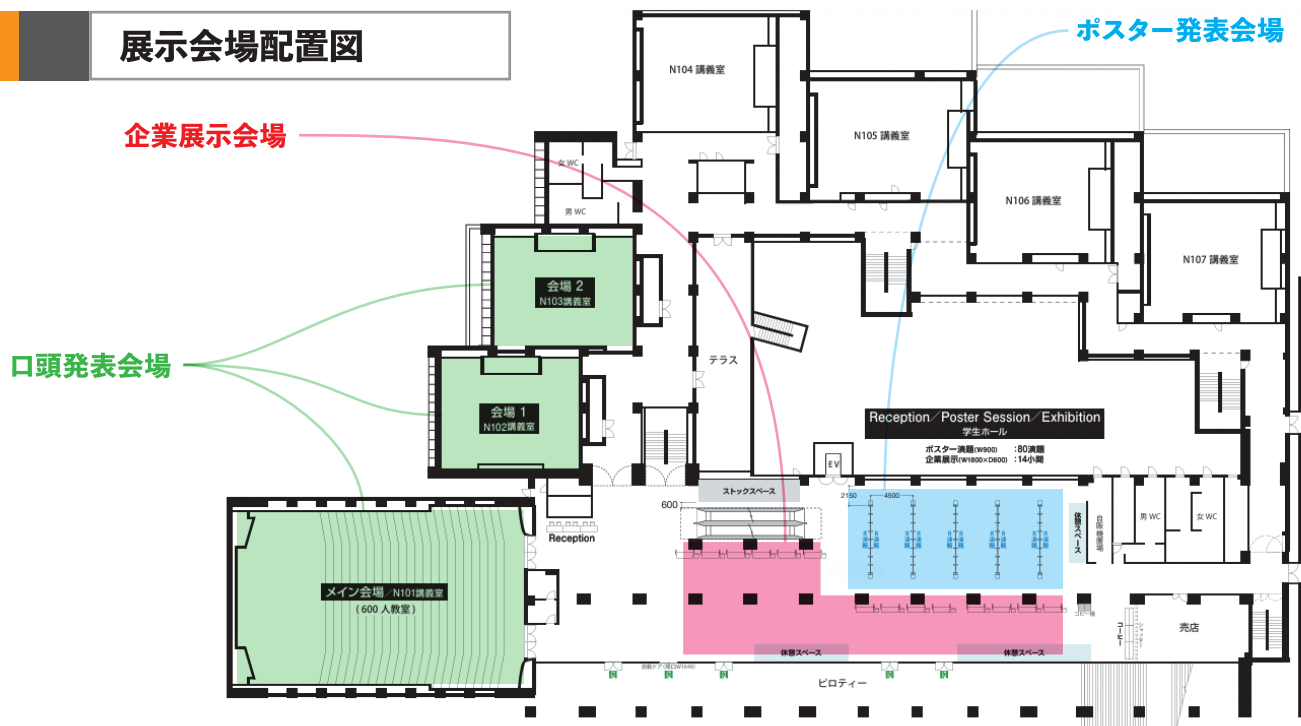
展示追加オプション(有料)

- 電気容量の追加
- カタログスタンド(1台) 7,500円
- その他(電力追加、スポットライト等)はご相談ください。

出展対象

真空チャンバー(真空フランジ、ゲートバルブ、バタフライバルブなど)、真空配管、真空排気装置(各種真空ポンプ入真空計、各種電源(直流、交流、パルス、高周波、マイクロ波)、電流導入端子、ガス・ガス導入用マスフローコントローラ、各種レーザー、光学部品(各種レンズ、XYステージなど)入質量分析装置、発光分光分析装置、薄膜分析装置(膜厚計、各種表面分析装置)、薄膜形成装置(スパッタリング装置プラズマCVD装置、MBE装置など)、プラズマエッチング装置、イオンビーム、電子ビーム、中性粒子ビームなど、オシロスコープ、スペクトルアナライザ、赤外線加熱装置など

展示会場配置図





プログラム冊子への広告掲載

2025年
12月19日金
申込締切

会議参加者全員へ配布いたしますプログラム冊子へ広告をご掲載いただくことができます。ご出展される企業・団体様は割引料金が適用されます。

掲載場所	色／スペース	掲載料金(出展者)	掲載料金(一般)
表4	4色／1ページ	¥100,000-	¥150,000-
表2	4色／1ページ	¥80,000-	¥120,000-
表3	4色／1ページ	¥70,000-	¥100,000-
前付	1色／1ページ	¥50,000-	¥70,000-
後付	1色／1ページ	¥30,000-	¥60,000-

※上記金額に消費税は含まれていません。

発行概要

- ・発行部数 450部(参加者全員)
※データでの提供に変更する可能性もございます。
- ・発行日 2026年3月2日(月)
- ・広告原稿サイズ 天地260mm×左右180mm
- ・広告申込締切日 2025年12月19日(金)
- ・広告原稿締切日 2026年1月9日(金)

広告データ仕様

広告原稿はアウトライン化済みのデータにてご提供ください。入稿仕様書および、出力見本を必ず添付してください。

推奨アプリケーション

Macintosh Illustrator, Photoshop

推奨貼込画像形式

EPS, TIFF(RGB不可)

企業協賛

2025年
12月19日金
申込締切

ISPlasma2026/IC-PLANTS2026の開催に伴い、協賛金を募っております。協賛企業には、HPやプログラムブックにて企業ロゴを掲載させていただいております(1口10,000円、5口以上にてお願い申し上げます)。詳細は下記HPもご参照ください。

https://www.isplasma.jp/co_sponsors.html

開催趣旨にご賛同いただき協賛に承諾いただける場合は、展示・広告申し込みの際にその旨お申し出ください。